



VIEW Summit®800

大面积，高精度尺寸测量系统

VIEW Summit 800 拥有高精度,测量速度快,测量范围大.高达300mm/每秒的XY平台移动速度(配备有线性马达驱动时)确保了生产车间高效的产出.

VIEW Summit 800 是测量大型封装产品的理想设备,如印刷电路板,模板,平板显示器,刻蚀板,掩模板以及小组件的嵌套组.

高精度单一或双重放大固定镜头光学系统

先进的图像处理功能,快速,准确,精确

强大的计量软件 and 数据分析工具可供选择



	X	Y	Z
行程(毫米)	800	820	150



计量软件:

VIEW 计量软件 (VMS).

可选项: Elements. 计量软件.

可选项: Measure-X. 计量软件.

可选软件模块:

区域多点自动聚焦 (AMF).

连续捕获图像 (CIC).

先进的图像滤波和图像拼接, 自定义UI.

MeasureFit Plus.

SmartProfile. 3D GD&T评估软件.

VMS 离线工作软件.

数字输入/输出 (Digital I/O).

	标准	可选		
X,Y,Z 行程 (毫米)	800 x 820 x 150	800 x 820 x 300		
X,Y,Z 光栅尺分辨率	0.1 μm	0.05 μm, 零膨胀材质		
平台驱动系统	光滑无摩擦的, 高速线性马达驱动 X&Y, 直流伺服马达 Z	无摩擦光滑高速线性马达 X & Y		
最大速度	X,Y - 200 毫米/每秒 Z - 100 毫米/每秒	X,Y - 300 毫米/每秒		
最大载重	75 kg			
成像光学	双单放大, 视场可交换式前置透镜, VIEW 2.5X 标距前置透镜	单单放大, 工厂安装背光的镜头和视场交换式前置透镜, 标距VIEW 1X 标距 2.5X 前置透镜		
前透镜 (视场可交换)	镜头	视场 (毫米)	镜头	视场 (毫米)
	VIEW 0.8X	低: 8.34 x 6.23, 高: 1.91 x 1.43	VIEW 0.8X	8.34 x 6.23
	VIEW 1X	低: 6.46 x 4.82, 高: 1.59 x 1.19	VIEW 1X	6.46 x 4.82
	VIEW 2.5X	低: 2.78 x 2.07, 高: 0.64 x 0.48	VIEW 2.5X	2.78 x 2.07
	VIEW 5X	低: 1.35 x 1.01, 高: 0.31 x 0.23	VIEW 5X	1.35 x 1.01
	VIEW 10X	低: 0.69 x 0.52, 高: 0.16 x 0.12	VIEW 10X	0.69 x 0.52
	VIEW 25X	低: 0.28 x 0.21, 高: 0.06 x 0.05	VIEW 25X	0.28 x 0.21
载重 (工厂安装)		VIEW 2X 载重 (仅限单单放大)		
计量相机	1.4 兆像素 (1392 x 1040), 1/2-英寸, 数码, 单色	1.4 兆像素 (1392 x 1040), 2/3-英寸, 数码, 单色, 2.0 兆像素 (1628 x 1236), 1/2-英寸, 数码, 单色, *根据需要其他相机可选		
照明	可编程 LED 照明系统, 同轴TTL面光和底光	多色可编程环形灯, 可灵活控制入射角度, 栅格自动聚焦系统		
感应器选项		Through-the-lens (TTL) 激光, 白光光谱探针感应器, 高精三角测量激光		
测量模式	快速移动和测量 (MAM)	连续图像捕获 (CIC)		
控制系统	四核处理器, Windows 7 操作系统, 网络和通讯端口			
控制器组件包	三轴操纵杆控制手动平台, 自锁停止/开始 开关		单-LCD 平板显示器, 计算机键盘鼠标, 双液晶平板 显示器, 计算机鼠标键盘 集成的可调节的操作平台	
电源要求	115/230 VAC, 50/60 Hz, 1-Phase, 2000W			
相关环境	温度: 18°-22° C, 稳定到 ± 1° C 相对湿度: 30% - 80% 振动低于 15Hz: <0.0015g			
XY 区域精度	E: (2.0+5L/1000) μm			
Z 线性精度	E: (1.8+5L/1000) μm		E: (1.5+5L/1000) μm (TTL 激光和可选5倍镜头)	
注意: 所有规格适用于热稳定性设备和20度认证温度				

- 1, 最大温度变化速度: 1度/每小时
- 2, 最大垂直温度梯度: 1度/每米
- 3, 在额定速度下均匀分布的负载为5千克, 取决于负载分布, 高负载下的精度可能少于标准精度。
- 4, 在标准平面上测量, 标准平面是指工作台面25毫米范围的一个平面。
- 5, 精度规格适用于标准和可选的2.5X光学组件, 或最高可用放大设置时更高的物镜放大倍数
- 6, E1 Z轴线性精度 和E2 XY 区域精度标准在QVI专利号790762 中有详细描述